

碳化硅宽带隙半导体技术

作者：郝跃等编著

出版社：北京：科学出版社

出版日期：2000

总页数：288

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10171641.html>）查找全本
阅读方式

碳化硅宽带隙半导体技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10171641.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10171641.html>

书名：碳化硅宽带隙半导体技术